

新闻发布

OmniGrade: 普发真空新型 定制的 残余气体 (RGA) 系统, 适用于严苛的洁净度验证应用

- 具有低检出限的残余气体分析系统
- 自动测量
- 模块化设计满足客户定制需求

德国阿斯拉尔, 2023 年 11 月 15 日。除了真空泵、检漏仪、测量与分析设备、组件以及真空室和真空系统之外, 如今普发真空还提供残余气体分析 (RGA) 系统的定制式完整解决方案。对技术要求高的快速增长市场越来越重视卓越的洁净度, 因为分子污染物会对产品的功能产生负面影响。因此, 越来越多的客户正在定义更高的洁净度要求。在 EUV 光刻领域, 这些是由“通用标准” GSA 07 1221 和 GSA 07 2221 等定义的。确保产品质量的关键在于使用普发真空名为 OmniGrade 的新型定制系统来正确确定高真空条件下的气体放气率。

OmniGrade 是一种先进的残余气体分析系统, 其设计旨在满足特定的测试要求。普发真空专家团队针对这些要求, 在兼顾总成本和交货时间的因素的同时开发了满足各种需求的解决方案。一种配置含有两个或三个腔室。它由放置质谱仪的光谱仪室和在测量过程中放置样品的测量室组成。为了最大限度地减少系统基板和通过自动传输系统的样品传输, 可以选配锁定室。OmniGrade 专为占地面积小、操作便捷与最新界面集成而设计。也可兼容一个洁净室。可根据需求选择质谱仪 (PrismaPro 或 HiQuad)。无论是纯系统还是与样品一起 (烘干) 的热力加热, 都有助于进一步优化测量能力并提高样品纯度。

“OmniGrade 采用了节能组件和先进技术设计，以减少浪费和排放。它有助于优化检查纯度的流程，从而减少客户生产中的浪费并更有效地利用资源”，普发真空仪器战略产品经理 Patrick Walther 在精密博览会上说道。

您可以在此处找到有关 **OmniGrade** 的更多信息：

<https://t1p.de/pfeiffer-vacuum-OmniGrade-zh>



图片说明：普发真空提供一个新型、定制的 RGA 系统，用于满足严苛的纯度验证要求

您可以在此处找到高分辨率图像，以供下载。

Press Contact:

Pfeiffer Vacuum GmbH

Public Relations

Sabine Neubrand

T +49 6441 802 1223

F +49 6441 802 1500

Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum (Shanghai) Co., Ltd.

普发真空技术（上海）有限公司

方子祥 / Steven Fang

Marketing / Marcom Manager

T +86 21-3393 3940 - ext 280

F +86 21-3393 3944

Steven.Fang@pfeiffer-vacuum.cn

3rd Floor, Building 2, Youyou Century Plaza, 428 South Yanggao Road

200127 Shanghai-China

中国上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场2号楼3楼

About Pfeiffer Vacuum

普发真空- (Stock Exchange Symbol PFV, ISIN DE0006916604)-作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一。我们不仅拥有全系列的复合轴承及全磁悬浮涡轮分子泵,同时还拥有各种旋片泵,干泵,罗茨泵,多级罗茨泵,检漏仪,真空计,质谱仪等产品以及真空管件和系统解决方案。从普发真空发明涡轮分子泵至今,我们在全球分析仪器、工业、科研、半导体和前端技术领域,始终代表着创新的解决方案和高品质的产品。公司自1890年创立至今百余年始始终走在世界前沿, 在全球拥有 4,000 多名员工, 20 多个办事处和 10 个制造工厂。

更多信息, 请浏览 www.pfeiffer-vacuum.cn